

装置・技術担当者一覧

総責任者： 入船 徹男

A. センター設置装置・技術

I. 超高压装置群（超高压実験装置と関連装置）		[通称]	[装置型番]	[管理・実施責任者]
(1)	マルチアンビル超高压発生装置	Orange-1000		西原遊, 新名亨
(2)	マルチアンビル超高压発生装置	Orange-3000		大内智博, Steeve Gréaux, 新名亨
(3)	D-DIA型超高压変形装置	Madonna I		大内智博, 西原遊, 新名亨
(4)	DIA型焼結ダイヤモンドアンビル超高压装置	Madonna II		西真之, 新名亨
(5)	ダイヤモンドアンビルセル	DAC		境毅, 大藤弘明
(6)	DAC用ファイバーレーザー加熱システム	Fiber laser		境毅, 大藤弘明
(7)	DAC用CO ₂ レーザー加熱システム	CO ₂ laser		境毅, 大藤弘明
(8)	マルチアンビル装置用超高压下弾性波速度測定装置	Ultrasonic	TDS5104	河野義生, Steeve Gréaux
II. 微小試料分析装置（電子顕微鏡および関連装置とX線回折・分光装置等）				
(9)	電界放出型走査電子顕微鏡（EDS付き）①	FE-SEM-EDS	JSM-7000F	大内智博, 西, 大藤弘明
(10)	電界放出型走査電子顕微鏡（EBSD付き）	FE-SEM-EBSD	JSM-7000F	大内智博, 西, 大藤弘明
	電界放出型走査電子顕微鏡（EDS付き）②		JSM-IT500HR	大内智博, 西
(11)	走査型電子顕微鏡（EDS付き）	SEM-EDS	JSM-6510LV	大内智博, 西, 大藤弘明
(12)	電界放出型透過電子顕微鏡（EDS付き）	FE-TEM	JEM-2100F	大内智博, 西, 大藤弘明
(13)	透過型電子顕微鏡	TEM	JEM-2010	大内智博, 大藤弘明
(14)	集束イオンビーム（デュアルビーム）加工装置	Dual Beam FIB	Sciós	境毅, 大藤弘明
(15)	集束イオンビーム加工装置	FIB	JEM-9310FIB	境毅, 大藤弘明
(16)	微小領域X線回折装置	Micro-focus XRD	RAPIDII-V/DW	境毅, 新名亨, 大藤弘明
(17)	粉末X線回折装置	Powder XRD	UltimaIV/DD	新名亨, 西, 境毅, 大藤弘明
(18)	顕微ラマン分光装置（日本分光）	Micro-Raman Spectroscopy	NRS-5100gr	境毅, 新名亨, 大藤弘明
(19)	顕微ラマン分光装置（Photon Design）	Micro-Raman Spectroscopy	RSM 800	境毅, 新名亨, 大藤弘明
(20)	顕微近赤外レーザーラマン分光装置	Micro-Raman (NIR) Spectroscopy	NRS-4500	境毅, 新名亨, 大藤弘明
(21)	顕微赤外分光装置	FT-IR	Spectrum One	西原遊, 新名亨
(22)	紫外可視近赤外分光システム	UV-Vis-NIR	V-670	新名亨, 大藤弘明
(23)	レーザー顕微鏡	Laser microscope	OPTELICS HYBRID L3	新名亨, 大藤弘明
(24)	イオン研磨加工装置（イオンスライサ）	Ion Slicer	EM-09100 IS	大内智博, 大藤弘明
(25)	イオン研磨加工装置（クロスセクションポリッシャ）	Cross Section Polisher	IB-19510CP	大内智博, 大藤弘明
(26)	イオン研磨加工装置（アルゴンイオンミリング）	PIPS	Model 691	大内智博, 大藤弘明
	オスミウム・白金・金・カーボン蒸着装置	Coater	Neoc-STB/JFC-1600/JEC-560	大内智博, 大藤弘明
III. 加工装置・その他の特徴ある装置				
(27)	超音波加工機		UM-150CS	西原遊, 大内智博
(28)	自動パーツ加工機①		MDX-540	西真之, 新名亨, Steeve Gréaux
	自動パーツ加工機②		MDX-40a	西原遊, 新名亨, 西真之, Steeve Gréaux
(29)	高温雰囲気炉①	大型炉	ATCM50-100/1700	大内智博, 新名亨
(29)	高温雰囲気炉②	小型炉	TS-4B06	西原遊, 新名亨
(30)	マイクロピッカース硬度計		HMV-G21DT	新名亨, 大藤弘明
	大型平面研磨盤		GS-BMHF	新名亨
	精密ボール盤		JIG-3M-1	西原遊, 新名亨, 大内智博
	コンターマシン		V-33	西原遊, 新名亨
	自動研磨機		EcoMet3000	西原遊, 新名亨, 大藤弘明
	ファイバーレーザー加工装置①	DAC用	FL-LM 01	境毅, 新名亨
	ファイバーレーザー加工装置②	MA用	ML-7111A	西原遊, 新名亨
	ダイヤモンド研磨機		MCBS-320	入船徹男, 新名亨
	大型NCタッピング装置		MTV-T310; KIRA, PCV-30	新名亨
	CCD形状観察装置（キーエンス）		VHX-2000	新名亨, 大藤弘明
	デジタルマイクロスコープ（ライカ）		DVM6	新名亨, 大藤弘明
	炉床昇降式高温電気炉		SPM65-17	河野義生
IV. 数値計算用コード				
(31)	金属材料シミュレーションコード			土屋卓久, 出倉春彦
(32)	数値流体シミュレーションコード			亀山真典
V. センター外設置装置・技術				
(33)	変形機構付きガイドブロック（Spring-8 BL04B1 ビームライン）			西原遊, 大内智博
(34)	X線その場観察弾性波速度測定装置（Spring-8 BL04B1 ビームライン）			河野義生, Steeve Gréaux
	高速度カメラ（Spring-8 BL04B2 ビームライン）		FASTCAM Mini AX100	河野義生
VI. センター合成のナノ多結晶ダイヤモンド（ヒメダイヤ）				
	各種の応用研究用としてヒメダイヤの合成ならびに最適加工	NPD		入船徹男, 新名亨